

code élément	lib long	libellé en anglais	responsable	nature	crédits	ONU	CM	TD	TP	Session 1					2ème chance O/N	2ème chance								
										C. Term	Contrôle continu		Type d'épreuve :	Durée		Nature de l'épreuve - Examen écrit - Examen oral ou pratique - Rendu d'un livrable - Restitution orale	% de Contrôle Continu	Nature de l'épreuve CC - Examen écrit - Examen oral ou pratique - Rendu d'un livrable - restitution orale	- Contrôle continu en présentiel (CCP) - Contrôle continu en ligne (CCL) - Contrôle terminal en présentiel (CTP) - Contrôle terminal en ligne (CTL)	Nombre minimum d'épreuves > 1 ou Nombre exact	Durée	Nature de l'épreuve - Examen écrit - Examen oral ou pratique - Rendu d'un livrable - Restitution orale	Type d'épreuve - contrôle continue en présentiel (CCP) - contrôle terminale en présentiel (CTP)	Report de la note de CCP ou CCL en 2nde chance  (indiquer : oui/non)
VT5IBLA	Anglais	English	J.Yelbert	UT	3	TAN		18				100%	écrit/oral		CCP									
VT5IBW1	Microsystèmes et microfabrication	Microsystems and microfabrication	T. Barrière	UE	6																			
VT5YCMFA	Conception et microfabrication salle blanche	Introduction to design and microfabrication for MEMS	F.Chollat	ELC	3	63	15	3	12			100%	écrit ou pratique	CCP	>1	O	01:30	examen écrit ou pratique	CTP	oui	40%	Evaluation supplémentaire de l'UE	comme ancienne session2	
VT5YPMFA	Procédés et microfabrication	Micro-manufacturing process	T.Barrière	ELC	3	60	21		12			100%	écrit	CCP	>1	O	01:30	examen écrit ou pratique	CTP	oui	30%	Evaluation supplémentaire de l'UE	comme ancienne session2	
VT5CONC	Conception	Mechanical design	B.Gaume	UE	6	60	42	18				100%	écrit	CCP	>1	O	03:00	Examen écrit	CTP	non	0%	Evaluation de remplacement de l'UE	comme ancienne session2	
VT5MECMC	Mécanique des milieux continus	Continuum mechanics	J.Chambert	UE	6	60	36	21	12			100%	écrit	CCP	>1	O	02:00	Examen écrit	CTP	oui	20%	Evaluation supplémentaire de l'UE	comme ancienne session2	
VT5MSYS	Mécanique des systèmes 2	Mechanical of systems 2	L.Bouakar	UE	3	60	12	15				100%	écrit	CCP	>1	O	02:00	Examen écrit	CTP	non	0%	Evaluation de remplacement de l'UE	comme ancienne session2	
VT5IBW2	Pratique de conception mécanique	Practice in mechanical design	B. Gaume	UE	6																			
VT5IBPJ	Outils pour le projet	Tools for project	C. Gallon	ELC	3	60	6	17				100%	écrit	CCP	>1	O	01:00	Examen écrit	CTP	non	0%	Evaluation de remplacement de l'UE	comme ancienne session2	
VT5YMC	Méthodologie en conception mécanique	Methodology in mechanical design	B. Gaume	ELC	3	60	7	10	10			100%	écrit	CCP	>1	N								
VT6IBAPP	Ouverture socio-économique - APP	Socio-economic development	G. Dupuis	UT	3	TIP		18				100%	écrit/oral/livrable	CCP	>1	N								
VT6IBSG	Stage	Internship	V. Walter	UE	6																			
VT6IBLAS	Anglais pour l'ingénieur	Technical english	N.Kacem	UE	3	63		18				100%	écrit	CCP	>1	O	01:00	Examen écrit	CTP	non	0%	Evaluation de remplacement de l'UE	comme ancienne session2	
VT6IGW1	Dynamique des systèmes discrets parcours GM	Discrete dynamic systems	N.Bouhaddi	UE	6																			
VT6YDYN1	Dynamique des systèmes discrets 1	Discrete dynamic systems 1	N.Bouhaddi	ELC	3	60	24	15				100%	écrit	CCP	>1	O	02:00	Examen écrit	CTP	non	0%	Evaluation de remplacement de l'UE	comme ancienne session2	
VT6YDYN3	Dynamique des systèmes discrets 3	Discrete dynamic systems 3	L.Guyout	ELC	3	60		10,5	16			100%	écrit ou pratique	CCP	>1	O	01:00	examen écrit ou pratique	CTP	non	0%	Evaluation de remplacement de l'UE	comme ancienne session2	
VT6IGW2	Méthodes numériques appliquées parcours GM	Applied numerical methods in mechanical engineering	B. Gaume	UE	6																			
VT6YCAPP	Conception appliquée	Applied design	B. Gaume	ELC	2	60	6	6	8			100%	écrit	CCP	>1	O	01:30	Examen écrit	CTP	oui	20%	Evaluation supplémentaire de l'UE	comme ancienne session2	
VT6YECOC	Ecoconception et ACV appliquée	Ecodesign life cycle analysis	B.Gaume	ELC	4	60	18	6	12			100%	écrit	CCP	>1	O	01:30	Examen écrit	CTP	oui	50%	Evaluation supplémentaire de l'UE	comme ancienne session2	
VT6MPFAO	Méthodes production et fabrication assistée par ordinateur	Methods of production and computer-aided manufacturing	L.Guyout	UE	6	60	33	20	12			100%	écrit	CCP	>1	O	03:00	examen écrit ou pratique	CTP	non	0%	Evaluation de remplacement de l'UE	comme ancienne session2	